

## バレル型スパッタ装置 SP-163000D



粉粒体、小片、小球等、基材同士が接触しても問題のない場合の成膜に適しています。回転バレル内に収納(最大収納量20000cc)された基材は、バレル内で混合され、基材の全表面に成膜できます。

### バレル型スパッタ装置SP-163000D仕様

○到達圧力	×10 <sup>-4</sup> Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 <sup>-4</sup> Pa台迄30分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	φ950mm×1800mmL SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	DC電源 700V 6.3KW 1台
○基板形状	粉・粒体 20000cc
○膜厚分布	—
○ターゲット寸法	150mm×1270mm(金属)
○ターゲット個数	1
○基板回転	バレル(φ600mm×1400mmL)横型回転
○基板加熱	常温～120℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:1300L/min メカニカルブースターポンプ:600m <sup>3</sup> /h 油拡散ポンプ:6300L/sec
○操作方法	自動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相160KVA 冷却水:100L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:10000mmW×8000mmD×1800mmH